

## 第30回プラズマエレクトロニクス講習会 報告

三菱電機(株) 友久 伸吾

題記講習会について以下に報告します。

- 1) 協賛：日本物理学会、電気学会、プラズマ・核融合学会、日本化学会、電子情報通信学会、放電学会、日本表面真空学会、ドライプロセスシンポジウム、化学工学会、CVD 反応分科会
- 2) 日時：2019年11月12日(火) 9:15~18:45  
場所：グランパークカンファレンス 401 ホール
- 3) 参加者：64名(昨年比-16名、学生8名)
- 4) 収支：
  - 【収入】1,754,000円  
(参加費 1,196,000円、広告 558,000円)
  - 【支出】661,613円  
(会場 270,490円、謝金/旅費 137,366円、印刷 35,471円、懇親会/会議 210,894円、雑費/輸送他 7,392円)
  - 【残金】1,092,387円
- 5) プログラムと概要
  1. 『反応性スパッタリングの基礎と応用展開』  
青山学院大学 重里 有三 先生
  2. 『プラズマの基礎と計測技術』  
埼玉大学 稲田 優貴 先生
  3. 『非平衡プラズマ生成制御とプロセス』  
大阪大学 節原 裕一 先生
  4. 『産業応用に向けたプラズマ装置開発の現状』  
魁半導体(株) 登尾 一幸 先生
  5. 『プラズマエッチングにおける  
プラズマダメージ制御の最前線』  
(株) ソニーセミコンダクタソリューションズ  
深沢 正永 先生  
終了後、懇親会(17:00~18:45)を開催

各先生より、それぞれのご講演テーマに沿って、これまでの経験を交えた幅広い知見を展開いただきました。多くの質疑応答に加え、講習会後の懇親会など、有意義な議論や情報交換などが行われました。

p2の参加者アンケートにまとめておりますように概ね好評ではあったものの、「分量が多く時間が足りない」という意見が複数みられました。講義時間を長くして2日間開催とすると会場確保や幹事だけではなく、参加者の予定確保も難しくなると考えられることから、テーマを絞ることなども検討が必要と思われまます。

最後に、ご多忙の中、ご講義を頂いた講師の皆様、企画・運営にご尽力頂いた平松幹事長をはじめとする担当幹事の皆様、事務手続き全般をサポート頂いた応物分科会担当の小田様にお礼申し上げます。

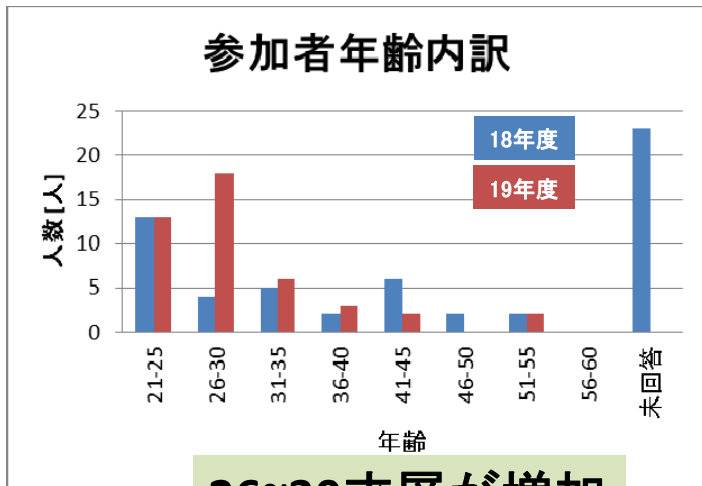
### 6) 次回の予定

詳細は未定ですが、2020年度も同時期の開催を予定しております。

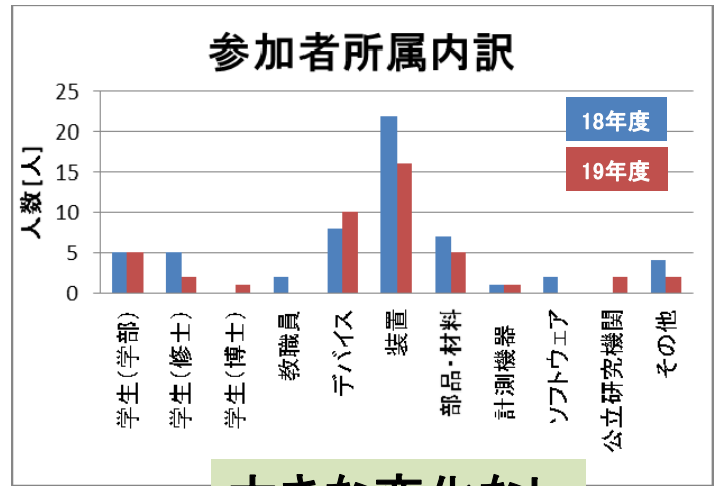
### ◎担当幹事：

飯野大輝(キオクシア)、占部継一郎(京都大学)、江藤宗一郎(日立製作所)、生沼学(三菱電機)、大島啓示(ソニーセミコンダクターソリューションズ)、鈴木歩太(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ)、永井久雄(パナソニック)、山田英明(産業技術総合研究所)、山羽隆(SanDisk)

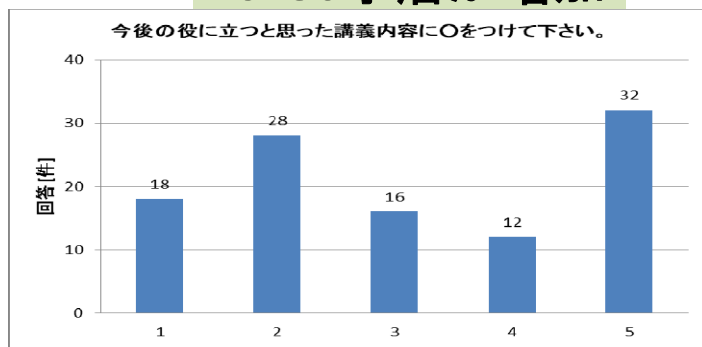
# 第30回プラズマエレクトロニクス講習会アンケート (回答44件)



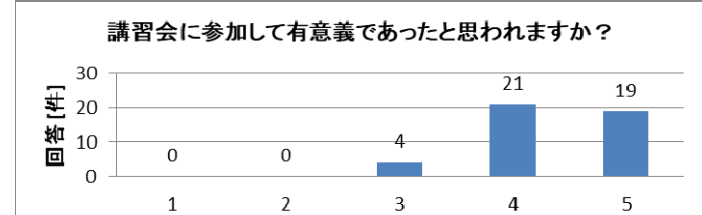
**26~30才層が増加**



**大きな変化なし**



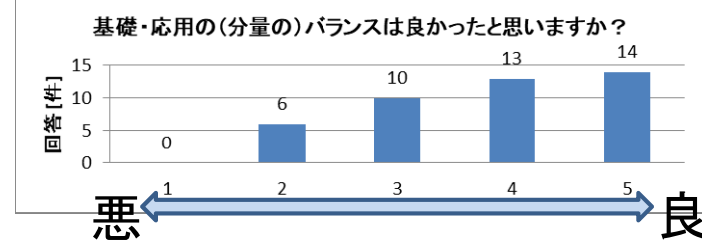
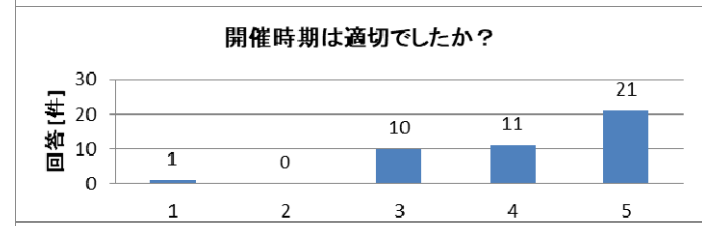
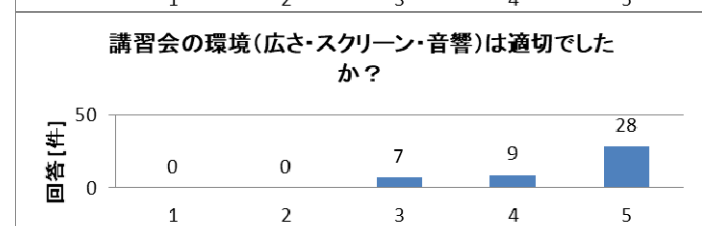
- 『反応性スパッタリングの基礎と応用展開』
- 『プラズマの基礎と計測技術』
- 『非平衡プラズマ生成制御とプロセス』
- 『産業応用に向けたプラズマ装置開発の現状』
- 『プラズマエッチングにおけるプラズマダメージ制御の最前線』



- その他意見 (要望を主に)
- ・内容が多く理解が追い付かない。
  - ・基礎の内容が多すぎて、時間が足りないように感じた
  - ・講義の順番を”浅→深”にしてほしい。
  - ・DPSの後の方がよかった



- 次回以降の希望テーマ等
- ・ALDやALD
  - ・機械学習
  - ・シミュレーション関係
  - ・ダメージ
  - ・環境応用
  - ・最先端プロセス、構造、課題
  - ・3D-NANDエッチング



概ね好評ではあるが、分量が多めで時間が足りない、という意見が複数あり。